## (19) **日本国特許庁(JP)**

# (12) 特 許 公 報(B2)

(11)特許番号

特許第6611819号 (P6611819)

(45) 発行日 令和1年11月27日(2019.11.27)

(24) 登録日 令和1年11月8日(2019.11.8)

(51) Int.Cl.			F I				
HO1M	10/04	(2006.01)	HO1M	10/04	Z		
HO1M	10/48	(2006.01)	HO1M	10/48	Z		
GO 1 N	1/00	(2006.01)	GO1N	1/00	1 O 1 R		
GO 1 N	1/22	(2006.01)	GO1N	1/22	В		
GO 1 N	30/16	(2006.01)	GO1N	30/16	K		
					請求項の数 10	(全 28 頁)	最終頁に続く

(21) 出願番号 特願2017-550339 (P2017-550339)

(86) (22) 出願日 平成28年11月8日 (2016.11.8)

(86) 国際出願番号 PCT/JP2016/083145 (87) 国際公開番号 W02017/082264

(87) 国際公開日 平成29年5月18日 (2017. 5. 18) 審査請求日 平成30年4月25日 (2018. 4. 25)

(31) 優先権主張番号 特願2015-219954 (P2015-219954) (32) 優先日 平成27年11月9日 (2015.11.9)

(33) 優先権主張国・地域又は機関

(33) 馊兀催王漱国:地枫又は燃闲 | 日本国(JP)

(31) 優先権主張番号 特願2016-136088 (P2016-136088)

(32) 優先日 平成28年7月8日 (2016.7.8)

(33) 優先権主張国・地域又は機関

日本国(JP)

||(73)特許権者 000001993

株式会社島津製作所

京都府京都市中京区西ノ京桑原町1番地

|(73)特許権者 515311408

株式会社イーシーフロンティア

京都府相楽郡精華町光台3丁目2番30号

||(74)代理人 100141852

弁理士 吉本 力

||(74)代理人 100152571

弁理士 新宅 将人

||(72) 発明者 小林 永佑

日本国京都府京都市中京区西ノ京桑原町1

番地 株式会社島津製作所内

最終頁に続く

(54) 【発明の名称】ガス分析用セル及びガス分析システム

# (57)【特許請求の範囲】

## 【請求項1】

内部に測定室を有するセル本体と、

前記測定室に配置された正極及び負極からなる1対の電極と、

前記測定室内に設けられ、前記1対の電極間に配置された隔膜と、

前記隔膜に対して前記正極側で発生したガス、及び、前記隔膜に対して前記負極側で発生したガスが、それぞれ分離して捕集される1対の捕集部とを備え、

前記1対の捕集部が、前記セル本体に個別に形成されており、

<u>前記1対の捕集部には、当該捕集部内にキャリアガスを流入させる流入口と、当該捕集</u>部内からキャリアガスを流出させる流出口とがそれぞれ形成されており、

<u>前記流入口から流入するキャリアガスに撹拌流を生じさせる</u>ことを特徴とするガス分析用セル。

### 【請求項2】

内部に測定室を有するセル本体と、

前記測定室に配置された正極及び負極からなる1対の電極と、

前記測定室内に設けられ、前記1対の電極間に配置された隔膜と、

前記隔膜に対して前記正極側で発生したガス、及び、前記隔膜に対して前記負極側で発生したガスが、それぞれ分離して捕集される1対の捕集部とを備え、

前記1対の捕集部が、前記セル本体に個別に形成されており、

前記1対の捕集部には、当該捕集部内にキャリアガスを流入させる流入口と、当該捕集

## 部内からキャリアガスを流出させる流出口とがそれぞれ形成されており、

前記流入口にキャリアガスを供給するガス供給流路と、

前記流出口からキャリアガスを排出させるガス排出流路と、

前記捕集部を介さずに前記ガス供給流路及びガス排出流路を接続するバイパス流路と、 前記ガス供給流路を前記捕集部又は前記バイパス流路のいずれに連通させるかを切り替

えるバイパス切替部とをさらに備えることを特徴とするガス分析用セル。

#### 【請求項3】

内部に測定室を有するセル本体と、

前記測定室に配置された正極及び負極からなる1対の電極と、

前記測定室内に設けられ、前記1対の電極間に配置された隔膜と、

前記隔膜に対して前記正極側で発生したガス、及び、前記隔膜に対して前記負極側で発生したガスが、それぞれ分離して捕集される1対の捕集部とを備え、

前記1対の捕集部が、前記セル本体に個別に形成されており、

<u>前記測定室内に収容され、前記1対の電極の一方を内部に保持する電極ガイドをさらに</u>備え、

前記電極ガイドには、前記1対の捕集部の一方に連通する開口が形成されていることを特徴とするガス分析用セル。

## 【請求項4】

前記1対の捕集部をそれぞれ閉塞する1対のセプタムをさらに備えることを特徴とする 請求項1~3のいずれか一項に記載のガス分析用セル。

【請求項5】

前記測定室に充填された電解液に浸漬される参照電極をさらに備えることを特徴とする請求項1~4のいずれか一項に記載のガス分析用セル。

#### 【請求項6】

前記1対の電極の他方は、前記電極ガイドの外側で前記測定室内に配置されており、 前記セル本体には、前記他方の電極側で発生したガスを前記1対の捕集部の他方に導く 誘導路が形成されていることを特徴とする請求項3に記載のガス分析用セル。

#### 【請求項7】

請求項1~6のいずれかに記載のガス分析用セルと、

前記 1 対の捕集部の少なくとも一方に捕集されたガスを分析するガス分析部とを備えることを特徴とするガス分析システム。

【請求項8】

ガス分析用セルと、ガス分析部と、供給切替部とを備え、

前記ガス分析用セルは、

内部に測定室を有するセル本体と、

前記測定室に配置された正極及び負極からなる1対の電極と、

前記測定室内に設けられ、前記1対の電極間に配置された隔膜と、

前記隔膜に対して前記正極側で発生したガス、及び、前記隔膜に対して前記負極側で発生したガスが、それぞれ分離して捕集される1対の捕集部とを備え、

前記1対の捕集部が、前記セル本体に個別に形成されており、

前記ガス分析部は、前記1対の捕集部の少なくとも一方に捕集されたガスを分析し、

前記供給切替部は、前記ガス分析用セル内で発生したガスをキャリアガスとともに前記ガス分析部に供給する第1供給状態、又は、前記ガス分析用セル内で発生したガスを含まないキャリアガスを前記ガス分析部に供給する第2供給状態のいずれかに切り替えることを特徴とするガス分析システム。

# 【請求項9】

前記第1供給状態では、前記ガス分析用セルを介して前記ガス分析部にキャリアガスが 供給され、

前記第2供給状態では、前記ガス分析用セルを介さずに前記ガス分析部にキャリアガスが供給されることを特徴とする請求項8に記載のガス分析システム。

10

20

30

40

#### 【請求項10】

前記ガス分析用セル内で発生したガスを収容するトラップ部をさらに備え、

前記第1供給状態では、前記トラップ部を介して前記ガス分析部にキャリアガスが供給 され、

前記第2供給状態では、前記トラップ部を介さずに前記ガス分析部にキャリアガスが供 給され、前記ガス分析用セル内で発生したガスが前記トラップ部に収容されることを特徴 とする請求項8に記載のガス分析システム。

## 【発明の詳細な説明】

# 【技術分野】

[0001]

本発明は、正極及び負極からなる1対の電極と、前記1対の電極間に配置された隔膜と が内部に設けられたガス分析用セル及びガス分析システムに関するものである。

#### 【背景技術】

# [0002]

リチウムイオン電池などの各種電池(二次電池)においては、放電時や充電時に正極及 び負極からガスが発生し、そのガスが電極や電解液を劣化させたり、放電や充電の効率を 低下させたりする場合がある。そのため、電池の研究又は開発においては、正極と負極と の間の電圧の変化と、その変化に伴い正極及び負極から発生するガスの成分や量との関係 を分析する場合がある。

## [0003]

このような場合に、実際の電池に使用されている材料と同じ材料で形成された正極及び 負極を使用し、それらの正極及び負極をガス分析用セル内に配置して放電や充電を行うこ とにより、当該ガス分析用セル内で発生したガスをガスクロマトグラフなどの分析装置で 分析することが行われている(例えば、下記非特許文献1参照)。

#### 【先行技術文献】

### 【非特許文献】

#### [0004]

【非特許文献 1 】 "Electrochemical Test Cell ECC-DEMS User Manual"、EL-CELL、[o nline]、平成27年2月11日、[平成27年10月28日検索]、インターネット URL: http:// el-cell.com/wp-content/uploads/manuals/ECC\_DEMS\_manual.pdf

#### 【発明の概要】

# 【発明が解決しようとする課題】

#### [0005]

電池の正極側及び負極側で発生するガスは、それぞれ異なる成分からなり、発生するガ スの量も正極側と負極側とで異なる。しかしながら、従来のガス分析用セルでは、正極側 及び負極側で発生するガスが、互いに分離されることなくガスクロマトグラフに送られて 分析が行われていた。そのため、正極側で発生するガスの成分及び量と、負極側で発生す るガスの成分及び量とを区別して精度よく分析を行うことができなかった。

# [0006]

本発明は、上記実情に鑑みてなされたものであり、より精度よく分析を行うことができ るガス分析用セル及びガス分析システムを提供することを目的とする。

## 【課題を解決するための手段】

## [0007]

(1) 本発明に係るガス分析用セルは、セル本体と、1対の電極と、隔膜と、1対の捕集 部とを備える。前記セル本体は、内部に測定室を有する。前記1対の電極は、前記測定室 に配置された正極及び負極からなる。前記隔膜は、前記1対の電極間に配置されている。 前記1対の捕集部には、前記隔膜に対して前記正極側で発生したガス、及び、前記隔膜に 対して前記負極側で発生したガスが、それぞれ分離して捕集される。

#### [00008]

このような構成によれば、隔膜に対して正極側で発生したガス、及び、隔膜に対して負

10

20

30

40

極側で発生したガスが、1対の捕集部にそれぞれ分離して捕集されるため、各捕集部に捕 集されたガスを個別に分析することができる。したがって、正極側及び負極側で発生する ガスを互いに分離させることなく分析する場合と比較して、より精度よく分析を行うこと ができる。

# [0009]

(2)前記ガス分析用セルは、前記1対の捕集部をそれぞれ閉塞する1対のセプタムをさ らに備えていてもよい。

# [0010]

このような構成によれば、 1 対のセプタムを介して各捕集部にシリンジを挿入させ、当 該シリンジにより、各捕集部に分離して捕集されたガスを個別に吸引して分析を行うこと ができる。したがって、より精度よく間欠分析を行うことができる。

#### [0011]

前記ガス分析用セルは、前記1対のセプタムをそれぞれ押圧して取り付ける1対のセプ タムホルダをさらに備えていてもよい。この場合、前記セプタムホルダ内の空間に遮蔽用 ガスが供給されてもよい。

### [0012]

このような構成によれば、1対のセプタムを介して各捕集部にシリンジを挿入させ、当 該シリンジにより、各捕集部に分離して捕集されたガスを個別に吸引した後、シリンジを セプタムから抜き取る際に、シリンジ内に外部の空気が入り込むのを防止することができ る。すなわち、シリンジ内が減圧された状態であっても、外部の空気の代わりに、セプタ ムホルダ内の空間に供給される遮蔽用ガスがシリンジ内に入り込むため、シリンジ内に外 部の空気が入り込むのを防止することができる。

### [0013]

(3)前記1対の捕集部には、当該捕集部内にキャリアガスを流入させる流入口と、当該 捕集部内からキャリアガスを流出させる流出口とがそれぞれ形成されていてもよい。

### [0014]

このような構成によれば、捕集部内に捕集されたガスが、流入口から捕集部内に流入す るキャリアガスとともに流出口から流出するため、このガスを分析することによって、よ り精度よく連続分析を行うことができる。

## [0015]

前記流入口から流入するキャリアガスの流入方向の延長線上に、前記流出口が配置され ていてもよい。

# [0016]

このような構成によれば、流入口と流出口とがキャリアガスの流入方向に沿って一直線 上に配置されるため、流路構成を簡略化することができる。

#### [0017]

(4)前記ガス分析用セルは、前記流入口から流入するキャリアガスに撹拌流を生じさせ てもよい。

## [ 0 0 1 8 ]

このような構成によれば、流入口から流入するキャリアガスに撹拌流を生じさせること により、捕集部に捕集されたガスを均一に撹拌することができるため、安定した分析結果 を得ることができる。

## [0019]

前記ガス分析用セルは、前記捕集部内を通過するキャリアガスの抵抗となることにより 撹拌流を生じさせる抵抗部材をさらに備えていてもよい。

# [0020]

このような構成によれば、流入口から流入するキャリアガスが、抵抗部材から抵抗を受 けることにより捕集部内で撹拌される。これにより、捕集部に捕集されたガスを均一に撹 拌して流出口から流出させ、このガスを分析することができるため、安定した分析結果を 得ることができる。

10

20

30

#### [0021]

(5)前記ガス分析用セルは、ガス供給流路と、ガス排出流路と、バイパス流路と、バイパス切替部とをさらに備えていてもよい。前記ガス供給流路は、前記流入口にキャリアガスを供給する。前記ガス排出流路は、前記流出口からキャリアガスを排出させる。前記バイパス流路は、前記捕集部を介さずに前記ガス供給流路及びガス排出流路を接続する。前記バイパス切替部は、前記ガス供給流路を前記捕集部又は前記バイパス流路のいずれに連通させるかを切り替える。

### [0022]

このような構成によれば、バイパス切替部によって、ガス供給流路を捕集部又はバイパス流路のいずれかに連通させることができる。したがって、ガス供給流路をバイパス流路に連通させることにより、バイパス流路を介してガス供給流路内の空気を排出した後、ガス供給流路を捕集部に連通させて、捕集部にキャリアガスを供給することができる。これにより、ガス供給流路内の空気が捕集部に流入し、分析に悪影響を与えることを防止できるため、より精度よく分析を行うことができる。

#### [0023]

(6)前記ガス分析用セルは、前記測定室に充填された電解液に浸漬される参照電極をさらに備えていてもよい。

## [0024]

このような構成によれば、参照電極により測定される電圧を参照電圧として、参照電極20と正極7との間、及び、参照電極20と負極8との間の電位の分析を行うことができる。

#### [0025]

(7)前記ガス分析用セルは、前記測定室内に収容され、前記1対の電極の一方を内部に保持する電極ガイドをさらに備えていてもよい。この場合、前記電極ガイドには、前記1対の捕集部の一方に連通する開口が形成されていてもよい。

#### [0026]

このような構成によれば、1対の電極の一方が電極ガイドにより保持されるとともに、 当該電極ガイド内で発生するガスが開口を介して1対の捕集部の一方に導かれる。これに より、一方の電極側で発生したガスが電極ガイド内から開口を介して一方の捕集部に良好 に捕集されるため、より精度よく分析を行うことができる。

#### [0027]

(8)前記1対の電極の他方は、前記電極ガイドの外側で前記測定室内に配置されていて もよい。この場合、前記セル本体には、前記他方の電極側で発生したガスを前記1対の捕 集部の他方に導く誘導路が形成されていてもよい。

# [0028]

このような構成によれば、電極ガイドの外側において他方の電極側で発生するガスが、 セル本体に形成された誘導路を介して他方の捕集部に良好に捕集されるため、より精度よ く分析を行うことができる。

## [0029]

(9)本発明に係るガス分析システムは、前記ガス分析用セルと、前記1対の捕集部の少 40なくとも一方に捕集されたガスを分析するガス分析部とを備える。

#### [0030]

このような構成によれば、ガス分析用セル内で発生したガスをガス分析部で分析することにより、より精度よくガス中の成分を分析することができる。

#### [0031]

(10)前記ガス分析システムは、前記ガス分析用セル内で発生したガスをキャリアガスとともに前記ガス分析部に供給する第1供給状態、又は、前記ガス分析用セル内で発生したガスを含まないキャリアガスを前記ガス分析部に供給する第2供給状態のいずれかに切り替える供給切替部をさらに備えていてもよい。

# [0032]

50

10

20

このような構成によれば、第1供給状態において、ガス分析用セル内で発生したガスをキャリアガスとともにガス分析部に直接供給することにより、連続分析を行うことができる。したがって、ガス分析用セル内で発生したガスがシリンジを用いてガス分析部に注入されるような構成と比較して、外部の空気がガスの流路内に混入しにくい。これにより、空気の混入が分析結果に影響を与えることを防止できるため、より精度よく連続分析を行うことができる。

#### [0033]

また、供給切替部が切り替えられる間のインターバルごとに、ガス分析用セル内で発生するガスをガス分析部に供給して分析することができるため、各インターバルで発生するガスの定量分析を正確に行うことができる。

[0034]

さらに、第2供給状態においてガス分析用セルを供給切替部に取り付ければ、当該ガス分析用セルがガス分析部に連通しない状態で配管の接続を行うことができる。これにより、ガス分析部に連通する配管を慌ててガス分析用セルに接続する必要がないため、取付作業が容易になる。

[0035]

(11)前記第1供給状態では、前記ガス分析用セルを介して前記ガス分析部にキャリアガスが供給され、前記第2供給状態では、前記ガス分析用セルを介さずに前記ガス分析部にキャリアガスが供給されてもよい。

[0036]

このような構成によれば、第1供給状態において、ガス分析用セル内で発生したガスが、当該ガス分析用セル内からガス分析部に直接供給される。したがって、簡単な構成で、より精度よく分析を行うことができる。

[0037]

(12)前記ガス分析システムは、前記ガス分析用セル内で発生したガスを収容するトラップ部をさらに備えていてもよい。この場合、前記第1供給状態では、前記トラップ部を介して前記ガス分析部にキャリアガスが供給され、前記第2供給状態では、前記トラップ部を介さずに前記ガス分析部にキャリアガスが供給され、前記ガス分析用セル内で発生したガスが前記トラップ部に収容されてもよい。

[0038]

[0039]

このような構成によれば、第2供給状態において、ガス分析用セル内で発生したガスをトラップ部に収容し、その後に第2供給状態から第1供給状態に切り替えれば、トラップ部に収容されているガスをキャリアガスとともにガス分析部に供給することができる。したがって、トラップ部内にガス分析用セル内よりも多くのガスを収容することができるような構成であれば、より多くのガスをトラップ部からガス分析部に供給することができるため、ガス分析部における検出感度が向上し、さらに精度よく分析を行うことができる。

(13)本発明に係る別のガス分析用セルは、セル本体と、1対の電極と、隔膜と、カバー部材と、複数のシール部材と、第1ガス供給流路とを備える。前記セル本体は、内部に測定室を有する。前記1対の電極は、前記測定室に配置された正極及び負極からなる。前記隔膜は、前記1対の電極間に配置されている。前記カバー部材は、前記セル本体に取り付けられ、前記測定室を閉塞する。前記複数のシール部材は、前記セル本体と前記カバー部材との間に設けられ、前記測定室を密閉する。前記第1ガス供給流路は、前記複数のシール部材の間に形成された空間にガスを供給する。

[0040]

このような構成によれば、セル本体とカバー部材との間に複数のシール部材が設けられるため、測定室の気密性を高め、セル本体内に外部の空気を入り込みにくくすることができる。さらに、複数のシール部材の間に形成された空間には、第1ガス供給流路からガスが供給されるため、外部の空気が流入したとしても、薄まる上に、外部に追い出すことが可能である。したがって、セル本体内に外部の空気が入り込むのを効果的に抑制すること

10

20

30

40

ができる。

## [0041]

(14)前記ガス分析用セルは、前記セル本体内にキャリアガスを供給する第2ガス供給 流路をさらに備えていてもよい。この場合、前記第1ガス供給流路は、前記複数のシール 部材の間に形成された空間に前記キャリアガスを供給してもよい。

#### [0042]

このような構成によれば、セル本体内に供給されるキャリアガスが、複数のシール部材の間に形成された空間にも供給される。したがって、上記空間内に供給されるガスがセル本体内に入り込んだ場合であっても、そのガスが分析に悪影響を与えることがないため、精度よく分析を行うことができる。また、キャリアガスとは異なるガスを準備する必要がないため、装置構成を簡略化することができる。

[0043]

(15)前記セル本体は、前記隔膜に対して前記正極側で発生したガス、及び、前記隔膜に対して前記負極側で発生したガスが、それぞれ分離して捕集される1対の捕集部を備えていてもよい。この場合、前記第2ガス供給流路は、前記1対の捕集部の少なくとも一方にキャリアガスを供給してもよい。

### [0044]

このような構成によれば、隔膜に対して正極側で発生したガス、及び、隔膜に対して負極側で発生したガスが、1対の捕集部にそれぞれ分離して捕集されるため、各捕集部に捕集されたガスを個別に分析することができる。したがって、正極側及び負極側で発生するガスを互いに分離させることなく分析する場合と比較して、より精度よく分析を行うことができる。

[0045]

(16)本発明に係る別のガス分析システムは、前記ガス分析用セルと、前記セル本体内 で発生したガスを分析するガス分析部とを備える。

[0046]

このような構成によれば、ガス分析用セル内で発生したガスをガス分析部で分析することにより、より精度よくガス中の成分を分析することができる。

[0047]

(17)前記ガス分析システムは、前記ガス分析用セル内で発生したガスをキャリアガスとともに前記ガス分析部に供給する第1供給状態、又は、前記ガス分析用セル内で発生したガスを含まないキャリアガスを前記ガス分析部に供給する第2供給状態のいずれかに切り替える供給切替部をさらに備えていてもよい。

[0048]

このような構成によれば、第1供給状態において、ガス分析用セル内で発生したガスをキャリアガスとともにガス分析部に直接供給することにより、連続分析を行うことができる。したがって、ガス分析用セル内で発生したガスがシリンジを用いてガス分析部に注入されるような構成と比較して、外部の空気がガスの流路内に混入しにくい。これにより、空気の混入が分析結果に影響を与えることを防止できるため、より精度よく連続分析を行うことができる。

[0049]

また、供給切替部が切り替えられる間のインターバルごとに、ガス分析用セル内で発生するガスをガス分析部に供給して分析することができるため、各インターバルで発生するガスの定量分析を正確に行うことができる。

[0050]

さらに、第2供給状態においてガス分析用セルを供給切替部に取り付ければ、当該ガス分析用セルがガス分析部に連通しない状態で配管の接続を行うことができる。これにより、ガス分析部に連通する配管を慌ててガス分析用セルに接続する必要がないため、取付作業が容易になる。

[0051]

10

20

30

(18)前記第1供給状態では、前記ガス分析用セルを介して前記ガス分析部にキャリア ガスが供給され、前記第2供給状態では、前記ガス分析用セルを介さずに前記ガス分析部 にキャリアガスが供給されてもよい。

#### [0052]

このような構成によれば、第1供給状態において、ガス分析用セル内で発生したガスが 、当該ガス分析用セル内からガス分析部に直接供給される。したがって、簡単な構成で、 より精度よく分析を行うことができる。

### [0053]

(19)前記ガス分析システムは、前記ガス分析用セル内で発生したガスを収容するトラ ップ部をさらに備えていてもよい。この場合、前記第1供給状態では、前記トラップ部を 介して前記ガス分析部にキャリアガスが供給され、前記第2供給状態では、前記トラップ 部を介さずに前記ガス分析部にキャリアガスが供給され、前記ガス分析用セル内で発生し たガスが前記トラップ部に収容されてもよい。

# [0054]

このような構成によれば、第2供給状態において、ガス分析用セル内で発生したガスを トラップ部に収容し、その後に第2供給状態から第1供給状態に切り替えれば、トラップ 部に収容されているガスをキャリアガスとともにガス分析部に供給することができる。し たがって、トラップ部内にガス分析用セル内よりも多くのガスを収容することができるよ うな構成であれば、より多くのガスをトラップ部からガス分析部に供給することができる ため、ガス分析部における検出感度が向上し、さらに精度よく分析を行うことができる。

#### 【発明の効果】

#### [0055]

本発明によれば、各捕集部に捕集されたガスを個別に分析することができるため、正極 側及び負極側で発生するガスを互いに分離させることなく分析する場合と比較して、より 精度よく分析を行うことができる。

### 【図面の簡単な説明】

#### [0056]

- 【図1】本発明の一実施形態に係るガス分析用セルの構成例を示した斜視図である。
- 【図2】図1のガス分析用セルを反対側から見た斜視図である。
- 【図3】図1のガス分析用セルの分解斜視図である。
- 【図4】図1のガス分析用セルを水平方向に切断したときの断面図である。
- 【図5A】図1のガス分析用セルを鉛直方向に切断したときの断面図である。
- 【図5B】図1のガス分析用セルを鉛直方向に切断したときの断面図であり、図5Aの場 合とは異なる位置における断面を示している。
- 【図6】三方バルブの動作について説明するための概略平面図である。
- 【図7A】捕集部内に抵抗部材がない状態で連続分析を行ったときの発生水素ガスの検出 電圧の変化の一例を示した図であり、流入口から捕集部内に流入するキャリアガスの流速 が5ml/minの場合を示している。

【図7B】捕集部内に抵抗部材がない状態で連続分析を行ったときの発生水素ガスの検出 電圧の変化の一例を示した図であり、流入口から捕集部内に流入するキャリアガスの流速 が10ml/minの場合を示している。

【図8A】捕集部内に抵抗部材がある状態で連続分析を行ったときの発生水素ガスの検出 電圧の変化の一例を示した図であり、流入口から捕集部内に流入するキャリアガスの流速 が5ml/minの場合を示している。

【図8B】捕集部内に抵抗部材がある状態で連続分析を行ったときの発生水素ガスの検出 電圧の変化の一例を示した図であり、流入口から捕集部内に流入するキャリアガスの流速 が 1 0 m l / m i n の場合を示している。

【図9】参照電極の電位に対して正極の電位を変化させて(すなわち、サイクリックボル タンメトリー)、充電及び放電を行ったときの電流の変化の一例を示した図である。

【図10A】複数のシール部材の間に形成された空間にガスを供給することなく充放電を

10

20

30

40

繰り返した場合の充放電容量の変化を示した図である。

【図10B】複数のシール部材の間に形成された空間にガスを供給しながら充放電を繰り返した場合の充放電容量の変化を示した図であり、ガスの流速が10ml/minの場合を示している。

【図10C】複数のシール部材の間に形成された空間にガスを供給しながら充放電を繰り返した場合の充放電容量の変化を示した図であり、ガスの流速が50m1/minの場合を示している。

【図11】セル本体内のガスに含まれる酸素濃度の経時変化を示した図である。

【図12】コネクタを介してセプタムホルダに遮蔽用ガスを流入させるか否かに応じたシリンジ内への酸素の流入量の違いについて説明するための図である。

【図13A】本発明の第1実施形態に係るガス分析システムの構成例を示した流路図である。

【図13B】本発明の第1実施形態に係るガス分析システムの構成例を示した流路図である。

【図14A】本発明の第2実施形態に係るガス分析システムの構成例を示した流路図である。

【図14B】本発明の第2実施形態に係るガス分析システムの構成例を示した流路図である。

【発明を実施するための形態】

[0057]

1 . ガス分析用セルの構成

図1は、本発明の一実施形態に係るガス分析用セル1の構成例を示した斜視図である。図2は、図1のガス分析用セル1を反対側から見た斜視図である。図3は、図1のガス分析用セル1の分解斜視図である。図4は、図1のガス分析用セル1を水平方向に切断したときの断面図である。図5Aは、図1のガス分析用セル1を鉛直方向に切断したときの断面図である。図5Bは、図1のガス分析用セル1を鉛直方向に切断したときの断面図であり、図5Aの場合とは異なる位置における断面を示している。

[0058]

ガス分析用セル 1 は、二次電池の一例であるリチウムイオン電池から発生するガスを分析するためのものである。このガス分析用セル 1 では、内部にリチウムイオン電池と同様の構造が再現されることにより、リチウムイオン電池と同様のガスを発生させ、そのガスをガスクロマトグラフなどで分析することができる。

[0059]

このガス分析用セル1は、セル本体2と、当該セル本体2に取り付けられた複数のカバー部材3,4,5とを備えている。これらのセル本体2及びカバー部材3,4,5により、セル本体2内に密閉された測定室6が形成され、当該測定室6内に、正極7、負極8、セパレータ(隔膜)9、電極ガイド10、第1集電部11、第2集電部12、セパレータ用ガスケット13及びスプリング14などが収容される(図3参照)。なお、図4、図5A及び図5Bでは、正極7、負極8及びセパレータ9などを省略して示している。

[0060]

セル本体 2 及び電極ガイド 1 0 は、例えばピーク(PEEK:ポリエーテルエーテルケトン)、ポリフェニレンサルファイド樹脂(PPS)、フッ素樹脂又はポリプロピレン(PP)により形成されている。セル本体 2 及び電極ガイド 1 0 の材料としては、水分の発生による劣化やガスの透過による分析精度の低下などを防止する観点から、水分を吸収しにくく、ガス透過性が低い材料であることが好ましい。各カバー部材 3 , 4 , 5 、第 1 集電部 1 1、第 2 集電部 1 2 及びスプリング 1 4 は、例えばステンレス鋼(SUS)により形成されている。セル本体 2 には、各カバー部材 3 , 4 , 5 が取り付けられる面に複数のネジ軸 1 6 が立設されており、各カバー部材 3 , 4 , 5 にネジ軸 1 6 を挿通させ、それらのネジ軸 1 6 にナット 1 7 を締め付けることにより、セル本体 2 に各カバー部材 3 , 4 , 5 が固定される。

10

20

30

40

#### [0061]

このとき、第1集電部11は、スプリング14を介してカバー部材3により第2集電部12側に押圧され、第2集電部12は、カバー部材4により第1集電部11側に押圧される。これにより、正極7,負極8及びセパレータ9が、第1集電部11と第2集電部12との間に挟持される。カバー部材3,4には、例えばステンレス鋼(SUS)により形成された集電棒18,19が固定されている。これにより、集電棒18がカバー部材3、スプリング14及び第1集電部11を介して正極7に電気的に接続されるとともに、集電棒19がカバー部材4及び第2集電部12を介して負極8に電気的に接続されるようになっている。

## [0062]

正極7は、例えばコバルト酸リチウムにより形成されている。負極8は、例えばグラフ ァイトにより形成されている。このような正極7及び負極8を備えたガス分析用セル1は 、「フルセル」と呼ばれている。正極7及び負極8は、例えば外径34mmの円板状であ り、実際のリチウムイオン電池の外径よりも大きく形成されている。セパレータ9は、例 えばポリプロピレンにより形成された外径41mmの多孔質で薄いフィルムであり、厚み は例えば24μmである。ただし、1対の電極7,8の間に配置される隔膜は、セパレー タ9に限られるものではない。正極7及び負極8は近接している必要があり、その距離は 隔膜の厚みで規定される。セパレータ9の上記厚みは一例に過ぎず、この値に限定される ものではない。隔膜の厚みは、例えば数100μm以下であることが好ましい。ただし、 正極7及び負極8の材料は、上記のような材料に限られるものではなく、例えば正極7は マンガン酸リチウム(スピネル構造)、リン酸鉄リチウム(オリビン構造)、三元系( NMC系)、ニッケル系(NCA系)などの他の材料により形成されていてもよいし、負 極8は、ハードカーボン、チタネイト、Si、Geなどの他の材料により形成されていて もよい。正極 7 又は負極 8 の一方がリチウムにより形成されたガス分析用セルは、 フセル」と呼ばれており、このようなガス分析用セルにも本発明を適用することができる 。リチウムイオン電池における電解液としては、水系電解液、無機固体電解質、有機固体 電解質、有機系電解液(EC-EMC系)、有機系電解液(EC-PC系)、イオン液体 系電解液、ゲルポリマー電解質などを例示することができる。また、リチウムイオン電池 から発生するガスを分析するガス分析用セルに限らず、鉛蓄電池、ニッケル水素電池、N AS電池、レドックスフロー電池、ナトリウムイオン電池、金属 - 空気電池、リチウム硫 黄電池、金属負極電池(カルシウム、マグネシウム、アルミニウム等)などから発生する ガスを分析するガス分析用セルにも本発明を適用することができる。ニッケル水素電池の 構成部材としては、例えば正極にオキシ水酸化ニッケル、負極に水素吸蔵合金及び水素、 電解液に水酸化カリウムを例示することができる。

## [0063]

測定室6内には、例えば有機溶媒からなる電解液が充填されており、この電解液内に正極7、負極8及びセパレータ9が浸漬されている。充電時には、正極7からリチウムイオンが発生し、このリチウムイオンがセパレータ9を透過して負極8側に移動する。一方、放電時には、負極8側にあるリチウムイオンがセパレータ9を透過して正極7側に移動する。

# [0064]

1 対の電極 7 , 8 に通電された状態で、各電極 7 , 8 からガスが発生した場合には、それらのガスがセル本体 2 に形成された 1 対の捕集部 2 1 , 2 2 に捕集される。具体的には、セパレータ 9 に対して正極 7 側で発生したガスは捕集部 2 1 に捕集され、セパレータ 9 に対して負極 8 側で発生したガスは捕集部 2 2 に捕集されるようになっている。本実施形態では、上述の通り正極 7 及び負極 8 を非常に短い距離で配置しながら、発生したガスをそれぞれ異なる捕集部 2 1 , 2 2 に分離することができる。

## [0065]

正極 7 及び負極 8 への印加電圧は、充放電装置(図示せず)により制御される。セル本体 2 内には、図 5 B に破線で示すように参照電極 2 0 が設けられていてもよい。参照電極

10

20

30

40

20は、例えば正極7と同じ材料であるリチウムにより形成されており、捕集部21に挿入されることにより、測定室6に充填された電解液に浸漬される。ただし、参照電極20の材料は、リチウムに限られるものではなく、他の材料であってもよい。参照電極20を用いれば、参照電極20により測定される電圧を参照電圧として、参照電極20と正極7との間、及び、参照電極20と負極8との間の電位の分析を行うことができる。

#### [0066]

第1集電部11は、円柱状に形成されている。第1集電部11における正極7側の端面は平坦面となっており、この平坦面全体が正極7に当接する。一方、第1集電部11における正極7側とは反対側の端面には、スプリング14を収容するための凹部111が形成されており、この凹部111内にスプリング14を収容した状態で、当該スプリング14を介して第1集電部11がカバー部材3により押圧される。

#### [0067]

電極ガイド10は、円筒状に形成されている。電極ガイド10の内径は、第1集電部11の外径と略一致しており、第1集電部11が電極ガイド10内に挿入された状態で測定室6内に配置される。正極7は、電極ガイド10の内部に配置された状態で保持される。電極ガイド10の周面には複数の開口15が形成されており、これらの開口15が捕集部21に連通している。したがって、セパレータ9に対して正極7側で発生したガスは、開口15を介して捕集部21に導かれる。これにより、正極7側で発生したガスが電極ガイド10内から開口15を介して捕集部21に良好に捕集される。

## [0068]

第2集電部12は、それぞれ円柱状に形成された小径部121及び大径部122が、同一軸線上で一体的に形成されることにより構成されている。小径部121における大径部122側とは反対側の端面は平坦面となっており、この平坦面全体が、電極ガイド10の外側で測定室6内に配置された負極8に当接する。

#### [0069]

セル本体2の内周面には、小径部121に対向する部分に円弧状の凹部が形成されており、この凹部が、負極8側で発生したガスを捕集部22に導く誘導路23を構成している。すなわち、セパレータ9に対して負極8側で発生したガスは、誘導路23を介して捕集部22に導かれるようになっている。これにより、電極ガイド10の外側において負極8側で発生するガスが、セル本体2に形成された誘導路23を介して捕集部22に良好に捕集される。

# [0070]

このように、本実施形態では、セパレータ9に対して正極7側で発生したガス、及び、セパレータ9に対して負極8側で発生したガスが、それぞれ分離して1対の捕集部21,2に捕集されるため、各捕集部21,2に捕集されたガスを個別に分析することができる。したがって、正極7側及び負極8側で発生するガスを互いに分離させることなく分析する場合と比較して、より精度よく分析を行うことができる。

### [0071]

カバー部材 5 には、例えばステンレス鋼(SUS)により形成された 1 対のセプタムホルダ 3 1 , 3 2 が取り付けられる。各セプタムホルダ 3 1 , 3 2 は、円筒状に形成されており、その下端面で円板状のセプタム 3 3 , 3 4 をそれぞれ押圧するようにしてカバー部材 5 に取り付けられる(図 5 A 及び図 5 B 参照)。一方のセプタムホルダ 3 1 は、正極 7 側で発生したガスを捕集する捕集部 2 1 に対して、セプタム 3 3 を挟んで対向している。他方のセプタムホルダ 3 2 は、負極 8 側で発生したガスを捕集する捕集部 2 2 に対して、セプタム 3 4 を挟んで対向している。

# [0072]

このように、 1 対の捕集部 2 1 , 2 2 は、それぞれ 1 対のセプタム 3 3 , 3 4 により閉塞されている。セプタム 3 3 , 3 4 は、例えばポリテトラフルオロエチレン( P T F E )又はブチルゴムにより形成されている。これにより、 1 対のセプタム 3 3 , 3 4 を介して各捕集部 2 1 , 2 2 にシリンジ(図示せず)を挿入させ、当該シリンジにより、各捕集部

20

10

30

40

2 1 , 2 2 に分離して捕集されたガスを個別に吸引して分析(間欠分析)を行うことができる。このような間欠分析は、シリンジを手動で操作することにより行われてもよいし、 シリンジを自動で制御することにより行われてもよい。

## [0073]

本実施形態では、上記のようなシリンジを用いた間欠分析だけでなく、各捕集部 2 1 , 2 2 にキャリアガスを供給して、セル本体 2 内で発生したガスをキャリアガスとともに各捕集部 2 1 , 2 2 から流出させることにより、このガスを分析(連続分析)することができるようになっている。そのために、各捕集部 2 1 , 2 2 には、捕集部 2 1 , 2 2 内にキャリアガスを流入させる流入口 2 1 1 , 2 2 1 と、捕集部 2 1 , 2 2 からキャリアガスを流出させる流出口 2 1 2 , 2 2 2 とが形成されている(図 3 参照)。

#### [0074]

各流入口211,221には、コネクタ213,223が取り付けられる。一方、各流出口212,22には、コネクタ214,224が取り付けられる。各コネクタ213,214,223,224には、それぞれ配管を介して三方バルブ215,216,225,226が接続されている(図1及び図2参照)。

#### [0075]

図6は、三方バルブ215,216,225,226の動作について説明するための概略平面図である。各流入口211,221に連通する三方バルブ215,225には、各流入口211,221にキャリアガスを供給するガス供給流路(第2ガス供給流路)217,227が接続されている。一方、各流出口212,222に連通する三方バルブ216,226には、各流出口212,222からキャリアガスを排出させるガス排出流路218,228が接続されている。

### [0076]

一方の捕集部21に連通する1対の三方バルブ215,216には、バイパス流路219が接続されている。したがって、バイパス切替部を構成する三方バルブ215,216を切り替えることによって、ガス供給流路217を捕集部21又はバイパス流路219のいずれか一方に連通させることができる。同様に、他方の捕集部22に連通する1対の三方バルブ225,226には、バイパス流路229が接続されている。したがって、バイパス切替部を構成する三方バルブ225,226を切り替えることによって、ガス供給流路227を捕集部22又はバイパス流路229のいずれか一方に連通させることができる

# [0077]

ガス供給流路217,227を捕集部21,22に連通させた状態では、ガス供給流路217,227及びガス排出流路218,228が捕集部21,22を介して接続され、ガス供給流路217,227から供給されるキャリアガスが、図6に矢印Aで示すように捕集部21,22に導かれる。これに対して、ガス供給流路217,227をバイパス流路219,229に連通させた状態では、ガス供給流路217,227及びガス排出流路218,228が捕集部21,22を介さずに接続され、ガス供給流路217,227から供給されるキャリアガスが、図6に矢印Bで示すようにバイパス流路219,229を介してガス排出流路218,228に導かれる。

# [0078]

したがって、ガス供給流路217,227をバイパス流路219,229に連通させることにより、バイパス流路219,229を介してガス供給流路217,227内の空気を排出した後、ガス供給流路217,227を捕集部21,22に連通させて、捕集部21,22にキャリアガスを供給することができる。これにより、ガス供給流路217,27内の空気が捕集部21,22に流入し、分析に悪影響を与えることを防止できるため、より精度よく分析を行うことができる。ただし、バイパス切替部は、ガス供給流路217,227を捕集部21,22又はバイパス流路219,229のいずれに連通させるかを切り替えることができるような構成であれば、三方バルブ215,216,225,226に限らず、他の部品により構成されていてもよい。

10

20

30

20

30

40

50

#### [0079]

図6に示すように、本実施形態では、流入口211から流入するキャリアガスの流入方向Dの延長線上に、流出口212が配置されている。このように、流入口211と流出口212とがキャリアガスの流入方D向に沿って一直線上に配置されるため、流路構成を簡略化することができる。流出口222についても同様に、流入口221から流入するキャリアガスの流入方向の延長線上に配置されている。

#### [0800]

また、流入口211からのキャリアガスの流入方向Dの延長線上の途中には、抵抗部材が設けられている。このように、キャリアガスの流路上に抵抗部材が設けられることにより、当該抵抗部材は、捕集部21内を通過するキャリアガスの抵抗となる。この場合、流入口211から流入するキャリアガスが、抵抗部材から抵抗を受けることにより捕集部21内で撹拌される。これにより、捕集部21に捕集されたガスを均一に撹拌して流出口212から流出させ、このガスを分析することができるため、安定した分析結果を得ることができる。

#### [0081]

図7A及び図7Bは、捕集部21内に抵抗部材がない状態で連続分析を行ったときの発生水素ガスの検出電圧の変化の一例を示した図である。また、図8A及び図8Bは、捕集部21内に抵抗部材がある状態で連続分析を行ったときの発生水素ガスの検出電圧の変化の一例を示した図である。この例では、正極7側で水素ガスが発生し、その水素ガスが捕集部21に捕集されて流出口212からキャリアガスとともに流出することにより、検出器で連続的に検出される場合について説明する。

#### [0082]

図7Aでは、流入口211から捕集部21内に流入するキャリアガス(ヘリウム)の流速が、5m1/minである。一方、図7Bでは、流入口211から捕集部21内に流入するキャリアガス(ヘリウム)の流速が、10m1/minである。これらの図7A及び図7Bから明らかなように、捕集部21内に抵抗部材がない状態では、キャリアガスの流速を増加させても検出電圧が安定しておらず、捕集部21に捕集されたガスが均一に撹拌されていないことが分かる。

## [0083]

図8Aでは、流入口211から捕集部21内に流入するキャリアガス(ヘリウム)の流速が、5m1/minである。一方、図8Bでは、流入口211から捕集部21内に流入するキャリアガス(ヘリウム)の流速が、10m1/minである。これらの図8A及び図8Bから明らかなように、捕集部21内に抵抗部材がある状態で、キャリアガスの流速が比較的遅い場合(例えば5m1/min)には検出電圧が安定していないが、キャリアガスの流速が比較的速い場合(例えば10m1/min)には検出電圧が安定している。このことから、キャリアガスの流速が一定値以上となり、抵抗部材に接触して撹拌流(撹拌されたキャリアガスの流れ)が生じる流速で流入した場合には、捕集部21に捕集されたガスが均一に撹拌されていることが分かる。

# [0084]

このように、流入口211から一定値以上の流速でキャリアガスを流入させることにより、抵抗部材に対してキャリアガスを良好に接触させて撹拌流を生じさせることができる。撹拌流を生じさせることにより、捕集部21に捕集されたガスを均一に撹拌することができるため、安定した分析結果を得ることができる。上記一定値は、例えば7.5m1/min以上であることが好ましく、10m1/min以上であればより好ましい。

#### [0085]

なお、捕集部21内に抵抗部材がない状態では、捕集部21に捕集されたガスの濃度が低くなりすぎるのを防止する観点から、捕集部21内に流入するキャリアガスの流速は5ml/min程度であることが好ましい。本実施形態では、抵抗部材を捕集部21内に設けた上で、捕集部21内に流入するキャリアガスの流速を通常の分析時よりも高い流速とすることにより、捕集部21に捕集されたガスを均一に撹拌することができる。

#### [0086]

抵抗部材は、例えば参照電極20により代用することができる。ただし、抵抗部材は参照電極20ではなく、他の部材により構成されていてもよい。また、図6では、流入口211からのキャリアガスの流入方向Dの延長線上の途中にのみ抵抗部材(参照電極20)が設けられているが、流入口221からのキャリアガスの流入方向の延長線上の途中にも抵抗部材が設けられていてもよい。

#### [0087]

参照電極20により測定される電圧を参照電圧として、参照電極20と正極7との間、 又は、参照電極20と負極8との間の電位の分析をより精度よく行う上で、参照電極20 は、捕集部21の中央部に配置されることが好ましい。しかし、図6に示すように、参照 電極20が捕集部21の中央部からずれた位置に配置された場合であっても、十分に精度 のよい分析を行うことが可能である。

#### [0088]

図9は、参照電極20の電位に対して正極7の電位を変化させて(すなわち、サイクリックボルタンメトリー)、充電及び放電を行ったときの電流の変化の一例を示した図である。この例では、正極7としてコバルト酸リチウムを使用し、負極8としてリチウムを使用したハーフセルのガス分析用セルについて、電解液として1M LiPF6(EC-DEC 1:1)を使用した実験結果を示している。参照電極20は、図6に示すように、捕集部21の中央部からずれた位置に配置されている。

## [0089]

このような材料からなる正極 7、 負極 8 及び電解液を用いた場合には、充電時(酸化側)のピーク電位が 4 . 0 ~ 4 . 1 Vであることが好ましく、放電時(還元側)のピーク電位が 3 . 8 ~ 3 . 9 Vであることが好ましい。図 9 に示した結果によれば、参照電極 2 0 が捕集部 2 1 の中央部からずれた位置に配置された場合であっても、充電時のピーク電位 V 1 が、 4 . 0 ~ 4 . 1 Vの範囲内にあり、放電時のピーク電位が 3 . 8 ~ 3 . 9 Vの範囲内にあるため、十分に精度のよい分析を行うことが可能であることが分かる。なお、この例では、ガス分析用セルがハーフセルである場合の実験結果が示されているが、フルセルのガス分析用セルにおいても同様の結果が得られると考えられる。

# [0090]

再び図3を参照すると、セル本体2と各カバー部材3,4との間には、それぞれのシール部材41,42が設けられている。シール部材41は、例えばパーフロにより形成された環状のOリングにより構成されている。一方、シール部材42は、例えばプチルゴムにより形成され、シール部材41よりも外周が長い環状のOリングにより構成されている。

#### [0091]

セル本体 2 とカバー部材 5 との間には、シール部材 4 3 , 4 4 , 4 5 が設けられている。シール部材 4 3 , 4 4 は、例えばパーフロにより形成された環状の 0 リングであり、シール部材 4 4 の方がシール部材 4 3 よりも外周が長い。一方、シール部材 4 5 は、例えばブチルゴムにより形成され、シール部材 4 4 よりも外周が長い環状の 0 リングにより構成されている。

### [0092]

このように、測定室 6 は、シール部材 4 1 ~ 4 5 により密閉されている。セル本体 2 と各カバー部材 3 , 4 , 5 との間に、それぞれ複数のシール部材 4 1 ~ 4 5 が設けられるため、測定室 6 の気密性を高め、セル本体 2 内に外部の空気を入り込みにくくすることができる。ただし、セル本体 2 と各カバー部材 3 , 4 との間に設けられるシール部材の数は、2 つに限らず、3 つ以上であってもよい。同様に、セル本体 2 とカバー部材 5 との間に設けられるシール部材の数は、3 つに限らず、2 つであってもよいし、4 つ以上であってもよい。また、シール部材の形状や材質は、上記のようなものに限らず、他の形状や材質であってもよい。

## [0093]

さらに、本実施形態では、各カバー部材3,4,5における複数のシール部材41~4

20

10

30

40

20

30

40

50

5の間に形成された空間に、ガスが供給されるようになっている。具体的には、図1及び図2に示すように、カバー部材3には、2つのコネクタ46,47が取り付けられており、配管61を介して一方のコネクタ46から流入するガスが、カバー部材3側のシール部材41とシール部材42との間の環状の空間を通過した後、他方のコネクタ47から流出する。カバー部材5には、2つのコネクタ48,49が取り付けられており、コネクタ48が配管62を介してコネクタ47に接続されている。これにより、コネクタ47から流出するガスがコネクタ48に流入し、シール部材44とシール部材45との間の環状の空間を通過した後、他方のコネクタ49から流出する。カバー部材4には、2つのコネクタ50,51が取り付けられており、コネクタ50が配管63を介してコネクタ49に接続されている。これにより、コネクタ49から流出するガスがコネクタ50に流入し、カバー部材4側のシール部材41とシール部材42との間の環状の空間を通過した後、他方のコネクタ51から流出する。

[0094]

コネクタ51は、配管64を介してT字管52に接続されており、このT字管52がさらに配管65,66を介してコネクタ53,54に接続されている。コネクタ53,54は、それぞれセプタムホルダ31,32に取り付けられている。これにより、コネクタ51から流出するガスは、T字管52及びコネクタ53,54を介してセプタムホルダ31,32に流入し、当該セプタムホルダ31,32内の空間を介して外部に放出される。具体的には、図5Aに矢印Cで示すように、コネクタ53,54を介してセプタムホルダ31,32に流入したガスは、セプタム33,34に遮られることにより、捕集部21,2に流入することなく、シリンジの挿入孔を介してセプタムホルダ31,32の外部に放出される。

[0095]

このように、配管 6 1 , 6 2 , 6 3 は、複数のシール部材 4 1 ~ 4 5 の間に形成された空間にガスを供給するガス供給流路(第 1 ガス供給流路)を構成している。複数のシール部材 4 1 ~ 4 5 の間に形成された空間には、配管 6 1 , 6 2 , 6 3 からガスが供給されるため、外部の空気が流入したとしても、薄まる上に、外部に追い出すことが可能である。したがって、セル本体 2 内に外部の空気が入り込むのを効果的に抑制することができる。

[0096]

配管 6 1 から供給され、配管 6 2 ,6 3 ,6 4 ,6 5 ,6 6 へと順次流れるガスは、ガス供給流路 2 1 7 ,2 2 7 から捕集部 2 1 ,2 2 に供給されるキャリアガスと同じキャリアガスであってもよい。この場合、ガス供給部(図示せず)から供給されるキャリアガスが、途中で分岐して配管 6 1 に導かれるようになっていてもよい。このように、セル本体 2 内に供給されるキャリアガスが、複数のシール部材 4 1 ~ 4 5 の間に形成された空間にも供給されるような構成であれば、上記空間内に供給されるガスがセル本体 2 内に入り込んだ場合であっても、そのガスが分析に悪影響を与えることがないため、精度よく分析を行うことができる。また、キャリアガスとは異なるガスを準備する必要がないため、装置構成を簡略化することができる。

[0097]

図10Aは、複数のシール部材41~45の間に形成された空間にガスを供給することなく充放電を繰り返した場合の充放電容量の変化を示した図である。図10B及び図10Cは、複数のシール部材41~45の間に形成された空間にガスを供給しながら充放電を繰り返した場合の充放電容量の変化を示した図であり、図10Bはガスの流速が10m1/minの場合、図10Cはガスの流速が50ml/minの場合をそれぞれ示している

[0098]

図10Aに示すように、1回目の充電時(S11)及び放電時(S12)の容量に対して、2回目の充電時(S21)及び放電時(S22)の容量はそれぞれ減少している。同様に、3回目の充電時(S31)及び放電時(S32)の容量はさらに減少し、4回目の充電時(S41)及び放電時(S42)の容量はさらに減少している。

20

30

40

50

#### [0099]

複数のシール部材 4 1 ~ 4 5 の間に形成された空間に 1 0 m 1 / m i n の流速でガスを供給しながら充放電を繰り返した場合であっても、図 1 0 B に示すように、充放電を繰り返すたびに容量が減少しているが、その減少量が小さいことが分かる。また、ガスの流速を 5 0 m 1 / m i n に増加させた場合には、図 1 0 C に示すように、充放電を繰り返すことによる容量の減少量がさらに小さくなる。

#### [0100]

充放電を繰り返した場合、セル本体2内に入り込む外部の空気に含まれる水分の影響により、電極(正極7又は負極8)が劣化するため、充放電容量は徐々に減少することとなる。しかし、複数のシール部材41~45の間に形成された空間にガスを供給すれば、図10B及び図10Cに示すように、充放電容量の減少量が小さくなっていることから、セル本体2内に外部の空気が入り込むのを効果的に抑制できていることが分かる。

## [0101]

図11は、セル本体2内のガスに含まれる酸素濃度の経時変化を示した図である。この例では、セル本体2内を密閉した状態で1日置いた場合にセル本体2内のガスから検出される酸素の検出強度が時間経過に対応付けて示されている。

#### [0102]

図11に直線L1で示した酸素濃度の変化は、複数のシール部材41~45の間に形成された空間にガスを供給しなかった場合の測定結果である。一方、図11に直線L2,L3で示した酸素濃度の変化は、複数のシール部材41~45の間に形成された空間にガスを供給した場合の測定結果であり、直線L2はガスの流速が10m1/minの場合、直線L3はガスの流速が50m1/minの場合を示している。

#### [0103]

これらを比較すると、ガスを供給しなかった場合(直線 L 1)には酸素濃度が上昇しやすいのに対して、ガスを供給した場合(直線 L 2 , L 3)には酸素濃度が上昇しにくく、セル本体 2 内に外部の空気が入り込むのを効果的に抑制できていることが分かる。また、ガスの流速が速いほどセル本体 2 内に外部の空気が入り込みにくいことが分かる。

#### [0104]

図12は、コネクタ53,54を介してセプタムホルダ31,32に遮蔽用ガスを流入させるか否かに応じたシリンジ内への酸素の流入量の違いについて説明するための図である。遮蔽用ガスは、例えばキャリアガス又はパージガスであるが、配管の引き回し等の観点からはキャリアガスであることが好ましい。この例では、セプタムホルダ31,32を介してセプタム33,34にシリンジを貫通させ、捕集部21,22内のガスを採取した場合に、ガスの採取量と、採取したガス中の酸素濃度を測定した結果との関係が示されている。

## [0105]

# [0106]

図12に示すように、コネクタ53,54を介してセプタムホルダ31,32に遮蔽用ガス(ヘリウム)を流入させなかった場合(Heなし)には、シリンジ内へのガスの採取量が多くなると、採取したガス中の酸素濃度が非常に高くなることから、シリンジ内に外部の空気が多量に吸い込まれていることが分かる。これに対して、コネクタ53,54を

介してセプタムホルダ 3 1 , 3 2 に遮蔽用ガス(ヘリウム)を流入させた場合(Heあり)には、シリンジ内へのガスの採取量が多くなっても、採取したガス中の酸素濃度が比較的低い。

## [0107]

これは、シリンジの先端部が位置するセプタムホルダ 3 1 , 3 2 内に遮蔽用ガス(ヘリウム)が供給されていることによるものである。すなわち、シリンジ内が減圧された状態であっても、外部の空気の代わりに、セプタムホルダ 3 1 , 3 2 内の空間に供給される遮蔽用ガスがシリンジ内に入り込むため、シリンジ内に外部の空気が入り込むのを防止することができる。

# [0108]

2.ガス分析システムの第1実施形態

図13A及び図13Bは、本発明の第1実施形態に係るガス分析システムの構成例を示した流路図である。このガス分析システムは、上述のようなガス分析用セル1と、当該ガス分析用セル1のセル本体2内で発生したガスを分析するガス分析部100とを備えている。

### [0109]

このガス分析システムは、ガス分析用セル1を用いて連続分析を行うためのものであり、1対の捕集部21,22の少なくとも一方に捕集されたガスがガス分析部100に導かれる。すなわち、図6に示すガス排出流路218から排出される捕集部21内のガス、及び、ガス排出流路228から排出される捕集部22内のガスの少なくとも一方が、ガス分析部100による分析対象となる。捕集部21で捕集されたガス、及び、捕集部22で捕集されたガスは、それぞれ異なるガス分析部100に導かれて分析される。図13A及び図13Bでは、捕集部21又は捕集部22の一方で捕集されたガスをガス分析部100で分析する場合について説明する。

#### [0110]

ガス分析部100には、フローコントローラ101、試料導入部102、カラム103及び検出器104などが備えられている。キャリアガスとしては、例えばヘリウムが用いられる。ただし、ヘリウムに限らず、アルゴンなどの他のガスがキャリアガスとして用いられてもよい。ガス供給部(図示せず)から供給されるキャリアガスの流量は、フローコントローラ101により制御される。フローコントローラ101からガス分析用セル1に供給されるキャリアガスは、セル本体2内で発生したガスとともに試料導入部102に導かれ、この試料導入部102からカラム103に導入される。

#### [0111]

カラム103に導入されたガスに含まれる成分は、カラム103を通過する過程で分離され、分離された各成分が検出器104により検出される。検出器104としては、例えばバリア放電イオン化検出器(BID)又はパルス放電イオン化検出器(PDD)が用いられる。これにより、検出感度が高いバリア放電イオン化検出器又はパルス放電イオン化検出器を用いて、より精度よく分析を行うことができる。

# [0112]

特に、電池に使用されるような正極7及び負極8から発生するガスには、水素、酸素、窒素、一酸化炭素、二酸化炭素又はメタンなどが含まれており、バリア放電イオン化検出器やパルス放電イオン化検出器は、これらのガスに対する検出感度は高いものの、ヘリウムは検出できない。したがって、キャリアガスとしてヘリウムを使用し、ガス分析用セル1内で発生するガスをバリア放電イオン化検出器又はパルス放電イオン化検出器で検出すれば、キャリアガスの成分の影響を受けることなく、ガス分析用セル1内で発生する幅広い種類のガスを精度よく分析することができる。ただし、検出器104は、これらに限られるものではなく、例えば熱伝導度型検出器(TCD)又は水素炎イオン化型検出器(FLD)などの他の検出器であってもよい。熱伝導度型検出器は、水素、酸素、窒素、一酸化炭素及びメタンの全ての成分に対して感度が悪く、水素炎イオン化型検出器は、メタンに感度があるものの、水素、酸素、窒素、一酸化炭素及び二酸化炭素には感

10

20

30

40

度がないため、水素、酸素、窒素、一酸化炭素、二酸化炭素及びメタンの全ての成分に対して感度がよいバリア放電イオン化検出器やパルス放電イオン化検出器は、本実施形態における検出器 1 0 4 としてより適切である。

# [0113]

図13A及び図13Bの例では、フローコントローラ101と試料導入部102との間に、供給切替部としての六方バルブ105を介してガス分析用セル1が接続されている。具体的には、六方バルブ105に備えられた6つのポート151~156のうち、第1ポート151にフローコントローラ101が接続されており、第2ポート152に試料導入部102が接続されている。また、ガス分析用セル1は、ガス供給流路217,227が第3ポート153に接続され、ガス排出流路218,228が第4ポート154に接続されている。第5ポート155には、ガス分析部100のフローコントローラ101とは異なるフローコントローラ106が接続されており、第6ポート156は排気ポートとなっている。フローコントローラ106からは、フローコントローラ101と同じキャリアガス(例えばヘリウム)が供給される。

## [0114]

図13Aの状態では、第1ポート151と第2ポート152が連通している。したがって、フローコントローラ101から供給されるキャリアガスは、ガス分析用セル1を介さずに試料導入部102へと送られ、当該試料導入部102からカラム103に供給されることとなる。この状態では、ガス分析用セル1において発生したガスはカラム103に導入されず、キャリアガスのみがカラム103に供給される。

#### [0115]

また、図13Aの状態では、第3ポート153と第5ポート155が連通し、第4ポート154と第6ポート156が連通している。したがって、フローコントローラ106から供給されるキャリアガスは、第5ポート155及び第3ポート153を介してガス分析用セル1内に供給され、セル本体2内で発生するガスとともに、第4ポート154及び第6ポート156を介して外部に排出される。

## [0116]

この状態から六方バルブ 1 0 5 が回転され、図 1 3 B のような状態になると、第 1 ポート 1 5 1 と第 3 ポート 1 5 3 が連通し、第 2 ポート 1 5 2 と第 4 ポート 1 5 4 が連通する。この図 1 3 B の状態では、フローコントローラ 1 0 1 からのキャリアガスがガス分析用セル 1 内に供給され、セル本体 2 内で発生するガスとともに試料導入部 1 0 2 からカラム 1 0 3 に導入される。また、第 5 ポート 1 5 5 と第 6 ポート 1 5 6 が連通し、フローコントローラ 1 0 6 からのキャリアガスは、そのまま外部に排出される。

#### [0117]

図13Bに示した状態は、ガス分析用セル1を介してガス分析部100にキャリアガスが供給される第1供給状態である。一方、図13Aに示した状態は、ガス分析用セル1を介さずにガス分析部100にキャリアガスが供給される第2供給状態である。六方バルブ105は、例えば5~40分程度の所定のインターバルで回転されることにより、第1供給状態と第2供給状態とが交互に切り替えられる。

### [0118]

本実施形態では、六方バルブ105により、ガス分析用セル1内で発生したガスをキャリアガスとともにガス分析部100に供給する第1供給状態(図13B参照)、又は、ガス分析用セル1内で発生したガスを含まないキャリアガスをガス分析部100に供給する第2供給状態(図13A参照)のいずれかに切り替えることができる。そして、第1供給状態では、ガス分析用セル1内で発生したガスをキャリアガスとともにガス分析部100に直接供給することにより、連続分析を行うことができる。したがって、ガス分析用セル1内で発生したガスがシリンジを用いてガス分析部100に注入されるような構成と比較して、外部の空気がガスの流路内に混入しにくい。これにより、空気の混入が分析結果に影響を与えることを防止できるため、より精度よく連続分析を行うことができる。

# [0119]

50

20

10

30

20

30

40

50

また、六方バルブ105が切り替えられる間のインターバルごとに、ガス分析用セル1 内で発生するガスをガス分析部100に供給して分析することができるため、各インター バルで発生するガスの定量分析を正確に行うことができる。

## [0120]

さらに、図13Aに示す第2供給状態においてガス分析用セル1を六方バルブ105に取り付ければ、当該ガス分析用セル1がガス分析部100に連通しない状態で配管の接続を行うことができる。これにより、ガス分析部100に連通する配管を慌ててガス分析用セル1に接続する必要がないため、取付作業が容易になる。

## [0121]

特に、本実施形態では、図13Bに示す第1供給状態において、ガス分析用セル1内で発生したガスが、当該ガス分析用セル1内からガス分析部100に直接供給される。したがって、簡単な構成で、より精度よく分析を行うことができる。ただし、供給切替部は、六方バルブ105に限らず、他のバルブにより構成されていてもよい。

### [0122]

なお、ガス分析用セル1及び六方バルブ105は、例えば室温~90 、より好ましくは80 程度の比較的高い温度に温調することもできる。これにより、厳密な耐久性チェックが可能となる。温調温度は、ガス分析用セル1内の電解液の沸点に応じて、適切な値に設定される。

#### [0123]

### 3.ガス分析システムの第2実施形態

図14A及び図14Bは、本発明の第2実施形態に係るガス分析システムの構成例を示した流路図である。このガス分析システムは、第1実施形態と同様にガス分析用セル1を用いて連続分析を行うためのものであり、ガス分析用セル1と、当該ガス分析用セル1のセル本体2内で発生したガスを分析するガス分析部100とを備えている。ガス分析部10の構成は第1実施形態と同様であるため、同様の構成については図に同一符号を付して詳細な説明を省略する。

#### [0124]

このガス分析システムでは、第1実施形態と同様に、1対の捕集部21,22の少なくとも一方に捕集されたガスがガス分析部100に導かれる。すなわち、図6に示すガス排出流路218から排出される捕集部21内のガス、及び、ガス排出流路228から排出される捕集部22内のガスの少なくとも一方が、ガス分析部100による分析対象となる。捕集部21で捕集されたガス、及び、捕集部22で捕集されたガスは、それぞれ異なるガス分析部100に導かれて分析される。図14A及び図14Bでは、捕集部21又は捕集部22の一方で捕集されたガスをガス分析部100で分析する場合について説明する。

# [0125]

図14A及び図14Bの例では、フローコントローラ101と試料導入部102との間に、供給切替部としての六方バルブ105を介してガス分析用セル1及びトラップ部(バッファ部)107が接続されている。トラップ部107は、いわゆるサンプルチューブであり、ガス分析用セル1の内容積よりも大きいバッファ領域を内部に有する中空状の部材である。

# [0126]

六方バルブ105に備えられた6つのポート151~156のうち、第1ポート151にフローコントローラ106が接続されており、フローコントローラ106と第1ポート151との間にガス分析用セル1が介装されている。すなわち、ガス分析用セル1のガス供給流路217,227がフローコントローラ106に接続され、ガス排出流路218,228が第1ポート151に接続されている。また、第2ポート152と第5ポート155が接続されており、これらの第2ポート152と第5ポート155との間にトラップ部107が介装されている。第6ポート156はフローコントローラ101に接続されており、第4ポート154は試料導入部102に接続されている。第3ポート153は排気ポートとなっている。フローコントローラ106からは、フローコントローラ101と同じ

キャリアガス(例えばヘリウム)が供給される。

## [0127]

図14Aの状態では、第4ポート154と第6ポート156が連通している。したがって、フローコントローラ101から供給されるキャリアガスは、トラップ部107を介さずに試料導入部102へと送られ、当該試料導入部102からカラム103に供給されることとなる。この状態では、ガス分析用セル1において発生したガスはカラム103に導入されず、キャリアガスのみがカラム103に供給される。

## [0128]

また、図14Aの状態では、第1ポート151と第2ポート152が連通し、第3ポート153と第5ポート155が連通している。したがって、フローコントローラ106から供給されるキャリアガスは、ガス分析用セル1内に供給され、セル本体2内で発生するガスとともに、第1ポート151及び第2ポート152を介してトラップ部107を通過した後、第5ポート155及び第3ポート153を介して外部に排出される。これにより、セル本体2内で発生したガスがトラップ部107に収容される。

## [0129]

この状態から六方バルブ105が回転され、図14Bのような状態になると、第2ポート152と第4ポート154が連通し、第5ポート155と第6ポート156が連通する。この図14Bの状態では、フローコントローラ101からのキャリアガスがトラップ部107内に供給され、当該トラップ部107内のガスとともに試料導入部102からカラム103に導入される。また、第1ポート151と第3ポート153が連通し、フローコントローラ106からのキャリアガスは、ガス分析用セル1を介して、そのまま外部に排出される。

### [0130]

図14Bに示した状態は、トラップ部107を介してガス分析部100にキャリアガスが供給される第1供給状態である。一方、図14Aに示した状態は、トラップ部107を介さずにガス分析部100にキャリアガスが供給される第2供給状態である。六方バルブ105は、例えば5~40分程度の所定のインターバルで回転されることにより、第1供給状態と第2供給状態とが交互に切り替えられる。

## [0131]

本実施形態では、六方バルブ105により、ガス分析用セル1内で発生してトラップ部107に収容されたガスをキャリアガスとともにガス分析部100に供給する第1供給状態(図14B参照)、又は、ガス分析用セル1内で発生したガスを含まないキャリアガスをガス分析部100に供給する第2供給状態(図14A参照)のいずれかに切り替えることができる。そして、第1供給状態では、ガス分析用セル1内で発生してトラップ部107に収容されたガスをキャリアガスとともにガス分析部100に直接供給することにより、連続分析を行うことができる。したがって、ガス分析用セル1内で発生したガスがシリンジを用いてガス分析部100に注入されるような構成と比較して、外部の空気がガスの流路内に混入しにくい。これにより、空気の混入が分析結果に影響を与えることを防止できるため、より精度よく連続分析を行うことができる。

### [0132]

また、六方バルブ105が切り替えられる間のインターバルごとに、ガス分析用セル1 内で発生してトラップ部107に収容されたガスをガス分析部100に供給して分析する ことができるため、各インターバルで発生するガスの定量分析を正確に行うことができる

## [0133]

特に、本実施形態では、図14Aに示す第2供給状態において、ガス分析用セル1内で発生したガスをトラップ部107に収容し、その後に図14Bに示す第1供給状態に切り替えれば、トラップ部107に収容されているガスをキャリアガスとともにガス分析部100に供給することができる。したがって、本実施形態のように、トラップ部107内のバッファ領域にガス分析用セル1内よりも多くのガスを収容することができるような構成

10

20

30

40

であれば、より多くのガスをトラップ部107からガス分析部100に供給することができるため、ガス分析部100における検出感度が向上し、さらに精度よく分析を行うことができる。

## [0134]

なお、ガス分析用セル1、六方バルブ105及びトラップ部107は、例えば室温~9 0 、より好ましくは80 程度の比較的高い温度に温調することもできる。これにより 、厳密な耐久性チェックが可能となる。温調温度は、ガス分析用セル1内の電解液の沸点 に応じて、適切な値に設定される。また、トラップ部107には、例えば高沸点物を通さ ないフィルタ(図示せず)が設けられることにより、カラム103の汚染が防止される。

# [0135]

第1実施形態及び第2実施形態のいずれにおいても、ガス分析用セル1のガス供給流路217,227には三方バルブ215,225が接続され、ガス排出流路218,228には三方バルブ216,226が接続されている(図6参照)。三方バルブ215,225は、ガス供給流路217,227を開閉させる供給側バルブを構成しており、三方バルブ216,226は、ガス排出流路218,228を開閉させる排出側バルブを構成している。

### [0136]

これにより、ガス分析用セル1の製造時に、空気がない(アルゴン又はヘリウムなどの特定のガスで置換された)環境下でガス分析用セル1を組み立てて、供給側バルブ(三方バルブ215,225)及び排出側バルブ(三方バルブ216,226)を閉じた状態とすれば、ガス分析用セル1内に空気が混入して内部の部品が劣化することがない。そして、ガス分析用セル1のガス供給流路217,227及びガス排出流路218,228を六方バルブ105に接続する作業を行った後、供給側バルブ(三方バルブ215,225)及び排出側バルブ(三方バルブ216,226)を開いた状態に切り替えれば、空気の混入を防止しつつ、容易に取付作業を行うことができる。ただし、供給側バルブ及び排出側バルブは、三方バルブ215,216,225,226に限らず、二方バルブなどの他のバルブであってもよい。

## [0137]

以上の実施形態では、電極ガイド10が、内部に正極7を保持するような構成について説明したが、これに限らず、内部に負極8を保持するような構成であってもよい。この場合、セパレータ9に対して負極8側で発生したガスが、開口15を介して捕集部22に捕集されるようになっていてもよい。また、誘導路23は、セパレータ9に対して負極8側で発生したガスを捕集部22に導くような構成に限らず、セパレータ9に対して正極7側で発生したガスを捕集部21に導くような構成であってもよい。

# [0138]

また、以上の実施形態では、セパレータ9に対して正極7側で発生したガス、及び、セパレータ9に対して負極8側で発生したガスが、それぞれ分離して1対の捕集部21,22に捕集されるような構成について説明した。しかし、複数のシール部材41~45の間に形成された空間にガスを供給することにより、当該空間内の圧力を高くするような構成は、1対の捕集部21,22に分離されていないような構成、すなわち、セパレータ9に対して正極7側で発生したガス、及び、セパレータ9に対して負極8側で発生したガスが、1つの捕集部に捕集されるような構成にも適用可能である。また、このとき使用されるガスは、キャリアガス以外のガスであってもよい。

# 【符号の説明】

### [0139]

- 1 ガス分析用セル
- 2 セル本体
- 3 , 4 , 5 カバー部材
- 6 測定室
- 7 正極

10

20

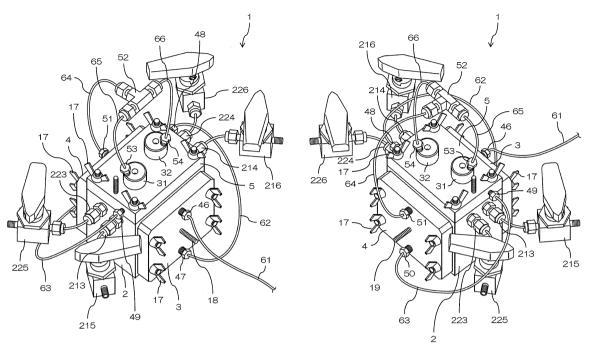
30

40

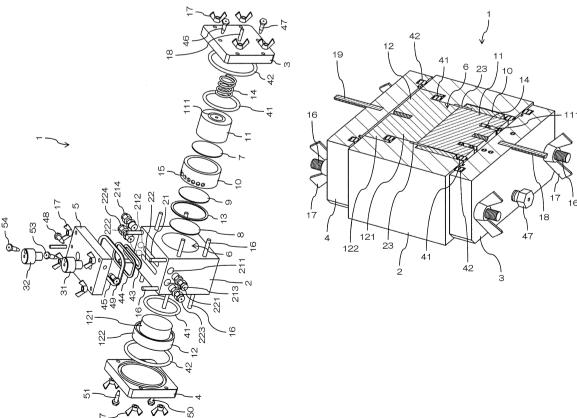
- 8 負極
- 9 セパレータ
- 10 電極ガイド
- 11,12 集電部
- 13 セパレータ用ガスケット
- 14 スプリング
- 15 開口
- 16 ネジ軸
- 17 ナット
- 18,19 集電棒
- 20 参照電極
- 2 1 , 2 2 捕集部
- 2 3 誘導路
- 31,32 セプタムホルダ
- 33,34 セプタム
- 41~45 シール部材
- 46~51 コネクタ
- 5 2 T字管
- 53 コネクタ
- 6 1 ~ 6 5 配管
- 100 ガス分析部
- 101 フローコントローラ
- 102 試料導入部
- 103 カラム
- 1 0 4 検出器
- 105 六方バルブ
- 106 フローコントローラ
- 1 0 7 トラップ部
- 2 1 1 流入口
- 2 1 2 流出口
- 2 1 3 , 2 1 4 コネクタ
- 2 1 5 , 2 1 6 三方バルブ
- 2 1 7 ガス供給流路
- 218 ガス排出流路
- 2 1 9 バイパス流路
- 225,226 三方バルブ
- 227 ガス供給流路
- 228 ガス排出流路
- 229 バイパス流路

20

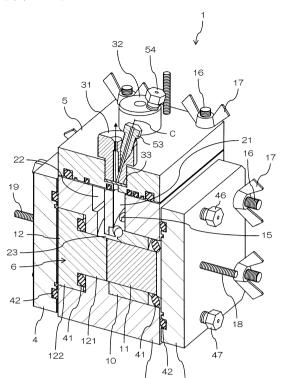
【図1】 【図2】



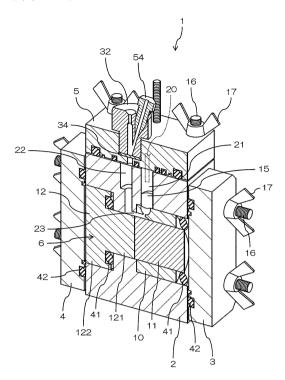
【図3】 【図4】



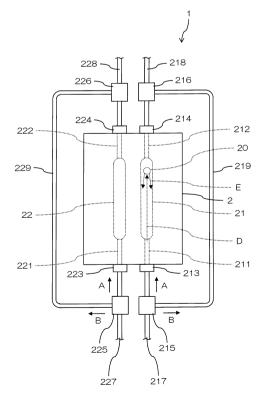
【図5A】



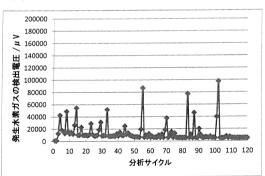
【図5B】



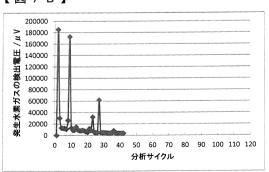
【図6】



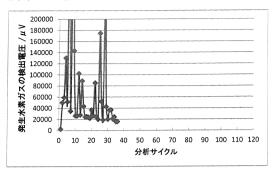
【図7A】



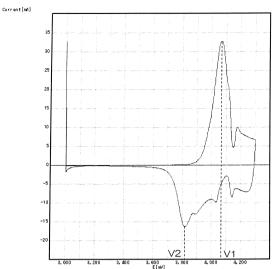
【図7B】



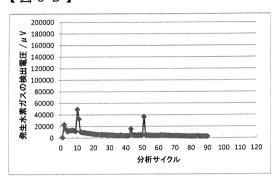
【図8A】



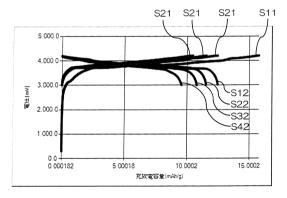
【図9】



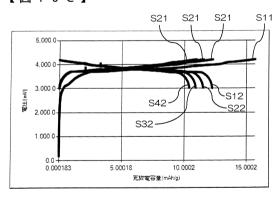
【図8B】



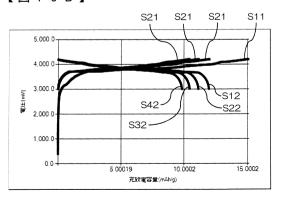
【図10A】



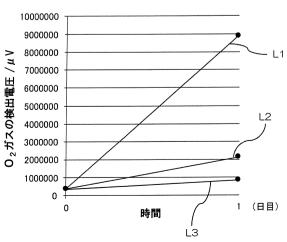
【図10C】



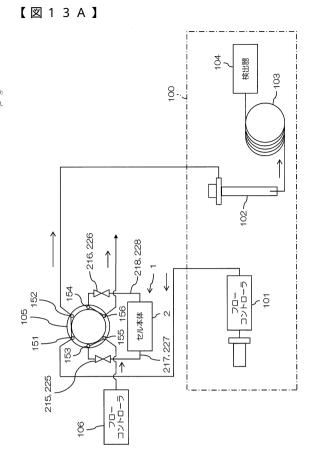
【図10B】

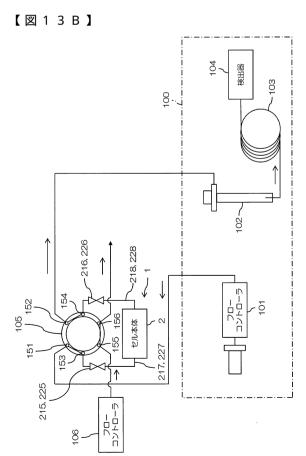


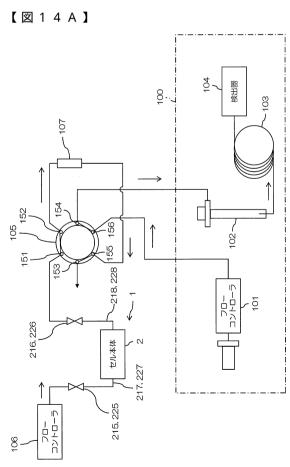
【図11】



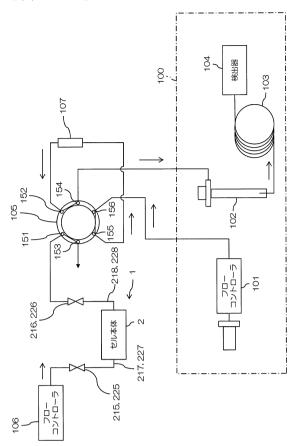
(図12)
0.025
0.02
0.01
0.01
0.005
0.01
0.005
0.01
0.005
0.01
0.005
0.01
0.02
0.3
0.4
0.5
0.6 (ml)
ガス採取最







【図14B】



### フロントページの続き

(51) Int.CI. F I

G 0 1 N 30/18 (2006.01) G 0 1 N 30/18 A G 0 1 N 30/26 (2006.01) G 0 1 N 30/26 E

(72)発明者 藤田 昌司

日本国京都府相楽郡精華町光台3丁目2番30号 株式会社イーシーフロンティア内

(72)発明者 宮下 統基

日本国京都府相楽郡精華町光台3丁目2番30号 株式会社イーシーフロンティア内

(72)発明者 槌谷 紀彦

日本国京都府相楽郡精華町光台3丁目2番30号 株式会社イーシーフロンティア内

(72)発明者 大野 千恵

日本国京都府相楽郡精華町光台3丁目2番30号 株式会社イーシーフロンティア内

# 審査官 松嶋 秀忠

(56)参考文献 特開2015-026504(JP,A)

特開2015-056308(JP,A)

特開2015-153731(JP,A)

特開2017-090224(JP,A)

- 参考製品 - ガス分析用H型セル,日本,Internet Archive[online],2017年2月2日,全文,Retrieved from the Internet:<URL:http://web.archive.org/web/20141218140827/http://ec-frontier.co.jp/,URL,http://web.archive.org/web/20141218140827/http://ec-frontier.co.jp/gas-h.pdf

# (58)調査した分野(Int.CI., DB名)

H01M 10/04-39

H01M 6/00-16

G01N 1/00

G01N 1/22

G01N 30/16

G01N 30/18

G01N 30/26

H 0 1 M 1 0 / 4 8